編集後記

日本顕微鏡学会は電子顕微鏡のみならず，あらゆるタイプの顕微鏡技術の基礎と応用に関連する研究について議論する場だと思います．顕微鏡技術におけるハードや解析技術自体は重要な研究分野です．一方，観察対象となる材料やデバイスへの興味や関心そのものが顕微鏡技術の発展を促しているともいえます．私自身，物質材料の基礎を所掌する研究所に長年在籍しており，個々の物質材料における興味の対象に対応した顕微計測が必要であると常々考えております．例えば，シリコン表面の清浄化を行う場合，熱酸化膜はどのように分解しつつ，清浄表面ドメインが創製されるのか，実空間観察で知りたいと思っています．そのためには高温環境で絶縁体表面をナノ計測可能な顕微鏡が必要となります．また，試料に歪みを与えた場合，構造や状態はどのように変化するのか，そのような興味がわいてくれば，制御された歪みを与えながら原子構造や電子状態をその場計測可能な顕微鏡が必要となります．ニーズに対応可能な顕微鏡技術がなければ，独自に工夫して技術開発することになります．

今回，和文誌編集委員としてプローブ顕微鏡関連技術に基づいた半導体表面分析の最近の展開に関する特集を担当しました．ご多忙の中，最先端のプローブ技術を紹介していただいた執筆者に御礼申し上げます．日進月歩の半導体産業にあって，デバイス材料の顕微解析に対する様々なニーズがあります．例えば，LSI 微細化が進展するに従って，CMOS-FET トランジスタはナノスケールに到達しています．このようなナノデバイス構造におけるキャリア濃度分布を一桁ナノの分解能で定量的に可視化したい，というニーズに対して，様々な顕微鏡技術が開発されております．具体的な対象に対する極めて高度な測定ニーズがあるからこそ，先端的な顕微鏡技術が開発されてきたと思います．特に，デバイス表面における物性や機能の計測では直接に対象と相互作用を行うナノプローブテクノロジーが重要となります．プローブ顕微鏡から派生した様々な顕微計測技術は半導体産業において更なる進化をしていくものと思います．

（物質・材料研究機構ナノ計測センター　藤田大介）

［複写される方へ］

本誌に掲載された著作物を複写したい方は，（社）日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の方でない限り，著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい．

（中法）学術著作権協会
〒107-0052　東京都港区赤坂 9-6-41　乃木坂ビル
TEL: 03-3475-5618,　FAX: 03-3475-5619
E-mail: jaacc@mtd.biglobe.ne.jp

著作権の転載・翻訳のような，複写以外の許諾は、直接本会へご連絡下さい．

アメリカ合衆国における複写については，次に連絡して下さい．
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA
Phone: 1-978-750-8400,　FAX: 1-978-646-8600

［Notice about photocopying］

In order to photocopy any work from this publication, you or your organization must obtain permission from the following organization which has been delegated for copyright clearance by the copyright owner of this publication.

〈Except in the USA〉
Japan Academic Association for Copyright Clearance, Inc.
（JAACC）
6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
TEL: 81-3-3475-5618,　FAX: 81-3-3475-5619
E-mail: jaacc@mtd.biglobe.ne.jp

〈In the USA〉
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA
Phone: 1-978-750-8400,　FAX: 1-978-646-8600

社団法人　日本顕微鏡学会

会　長　廣川信隆
副会長　進藤大輔
監　事　中村吉男・森博太郎
常務理事
竹田精治・年森清隆・杉山昌章・高野吉郎
理　事
楠美智子・菅沼龍夫・出澤真理・朝山匡一郎
幾原雄一・乾　晴行・大槻勝紀
竹花一成・富取正彦・幡場良明

編集委員会
委員長　小澤一史
副委員長　倉田博基
佐藤主税・千田隆夫・螺良愛郎・中村桂一郎
光岡　薫・山田作夫・松﨑利行
朝山匡一郎・一色俊之・今野豊彦
原田　研・藤田大介・武藤俊介

顕　微　鏡
Vol. 44,　No. 3
平成 21 年 9 月 30 日　発行
定　価 3,000 円（税込）

編集人　「顕微鏡」編集委員会
委員長　小澤一史
〒 113-8602 東京都文京区千駄木 1-1-5
日本医科大学大学院医学研究科生体制御形態科学分野
電話（03）3822-2131（内）5299
FAX（03）5685-6640
E-mail: microscopy@nms.ac.jp
【編集係】E-mail: microscopy@nacos.com

発行人　社団法人　日本顕微鏡学会

印刷所　中西印刷株式会社
〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入
電話（075）441-3155

発行所　社団法人　日本顕微鏡学会
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-19
電話（03）5389-6640,　FAX（03）3368-2827
払込銀行：みずほ銀行本郷支店

（禁無断転載）